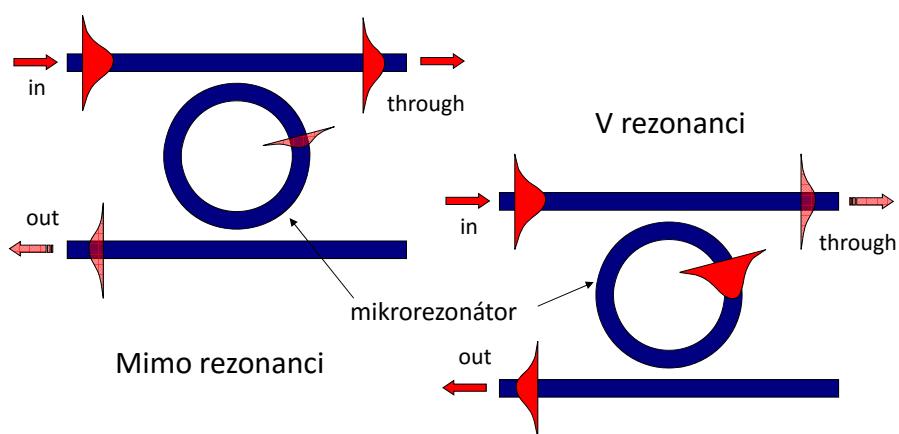


Mikrezonátory v integrované fotonice

Úloha

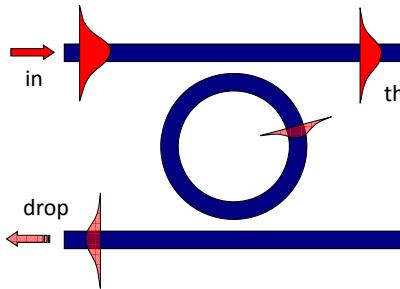
Vlnovodné struktury s mikrezonátory

(≥ 1990, B. E. Little *et al.*, MIT, Cambridge, USA)



Úloha

Spektrální vlastnosti mikrorezonátoru



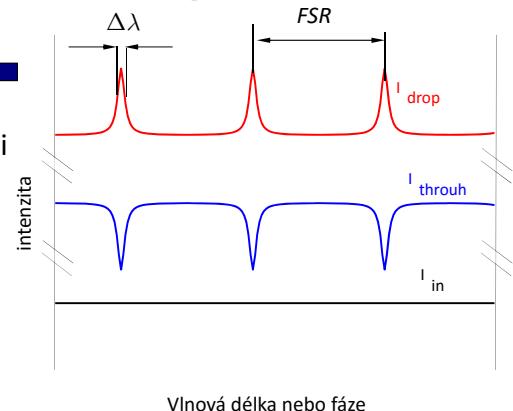
Vzdálenost mezi rezonancemi

$$FSR \approx \lambda_q^2 / (\pi N_g D)$$

„Jemnost“ $F = FSR / \Delta\lambda$

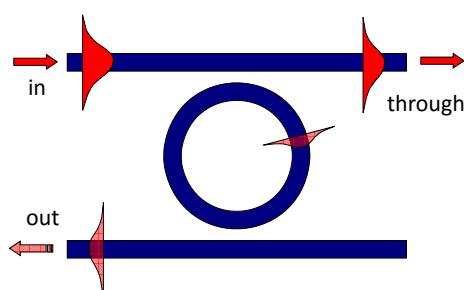
Činitel jakosti $Q = qF$

Rezonanční vln. délka
 $\pi ND = q\lambda_q$, q celé číslo ($10^2 - 10^3$)



Úloha

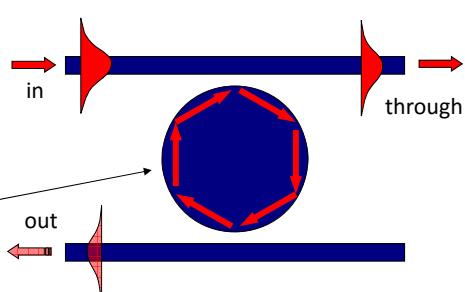
Žebrový vlnovod, nebo mikrodisk?



Žebrový vlnovod:
 technologicky náročnější,
 jednodušší návrh a modelování

Mikrodisk:

technologicky jednodušší,
 velmi náročný návrh a modelování
 („whispering gallery modes“)



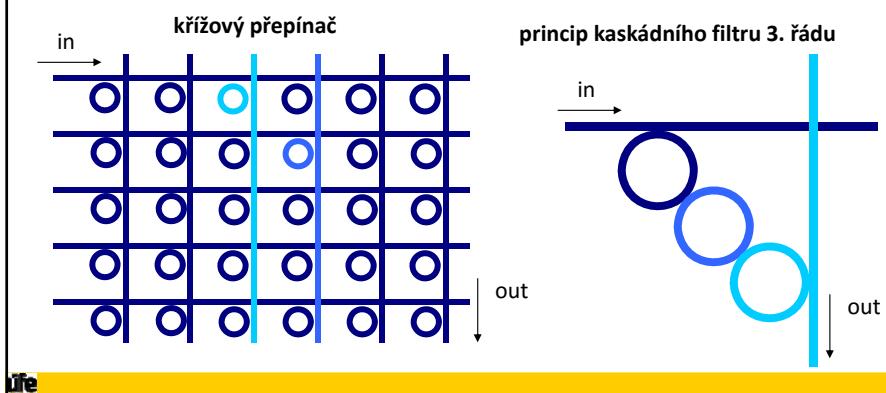
Úloha

Mikrorezonátor jako stavební prvek integrovaných fotonických struktur

Pasivní mikrorezonátor – spektrální filtr, add-drop de/multiplexor

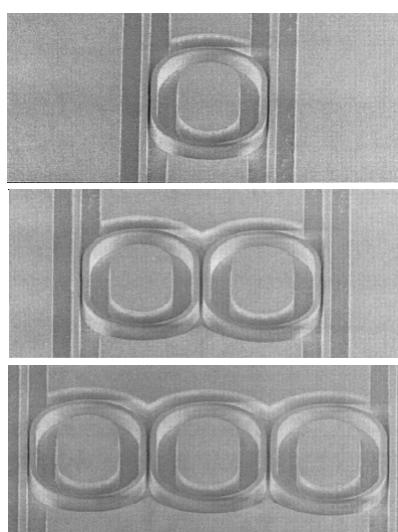
Syntéza tvaru spektrálních charakteristik – kaskádní řazení mikrorezonátorů

Elektroopticky/termoopticky laditelný mikrorezonátor – modulátor, přepínač ($\Delta f \approx 1 \text{ GHz}$)



Technologické aspekty

Laterální vazba mezi mikrorezonátorem a vlnovodem je velmi kritická:



MIT, Cambridge, 2000

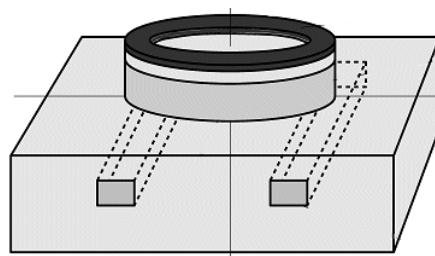
$\text{Al}_{0,5}\text{Ga}_{0,5}\text{As}-\text{GaAs}$ systém

šířka vlnovodů $0,42-0,62 \mu\text{m}$

šířka štěrbin $0,18-0,32 \mu\text{m}$

hloubka leptání $2 \mu\text{m}$

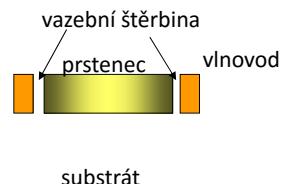
Alternativa: vertikální vazba



Laterální a vertikální vazba mezi μ R a vlnovodem

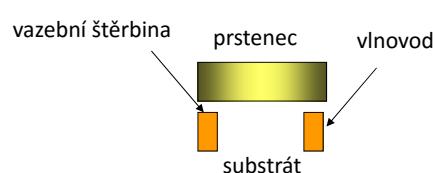
Laterální vazba

Jednostupňová litografie
kritická vazební štěrbina
menší flexibilita
3D vektorové modelování
zádoucí



Vertikální vazba

dvooustupňová litografie
lepší reprodukčnost
větší flexibilita
3D vektorové modelování
nezbytné

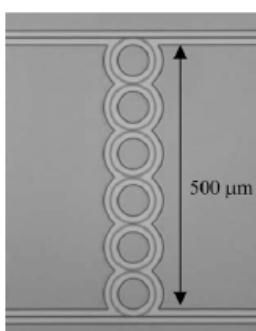


Úloha

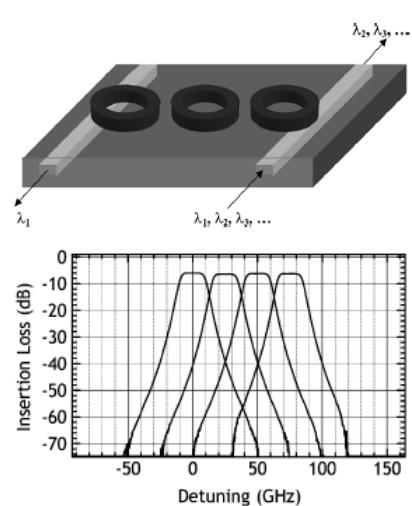
Vlnovodné filtry na bázi mikrorezonátorů

Příklad 1: Termoopticky laděný filtr vyšších řádů

Filtry 1. až 11. řádu, $\phi \approx 72 \mu\text{m}$
 $\text{SiO}_2/\text{Hydex}$ ($n_s = 1,45$, $n_g = 1,7$), $\phi \approx 50 \mu\text{m}$
ztráty na čipu $1 \div 1,5 \text{ dB}$
Little Optics, Inc., PTL, Sept. 2004
(nyní Infinera)



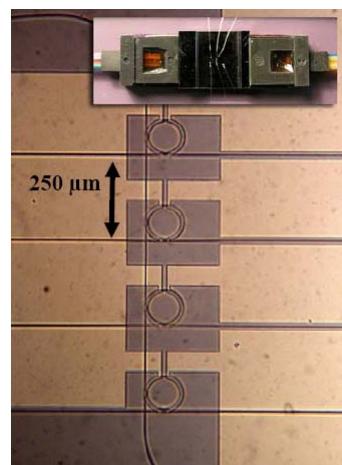
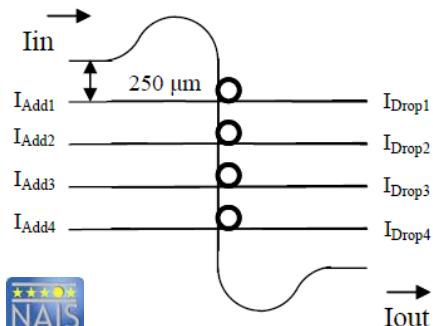
Termoopticky
laděné
spektrální
charakteristiky
filtru 5. řádu,
 $\Delta f = 25 \text{ GHz}$



Úloha

“Demonstrátor“ projektu NAIS

Rekonfigurovatelný demultiplexor
s termoopticky laděnými mikrorezonátory
(Realizace: University of Twente, NL,
systémové testy: Nortel, UK)

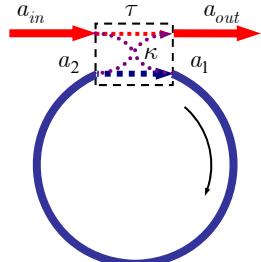


Úloha

Využití nelineárních optických efektů
ve fotonických strukturách s mikrorezonátory

Úloha

Nelineární šíření optického záření v mikrorezonátoru: Kerrovska nelinearity → automodulace fáze



$$\begin{pmatrix} a_{out} \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau & \kappa \\ \kappa & \tau \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{in} \\ a_2 \end{pmatrix}$$

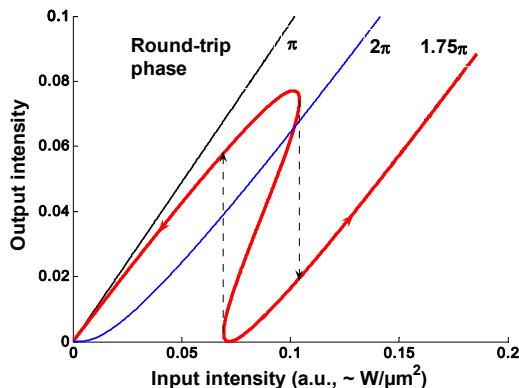
$$a_{in} = \frac{a_1 - \tau a_2}{\kappa},$$

$$a_{out} = \tau a_{in} + \kappa a_2$$

$$a_2 = a_1 b e^{i\phi_L} e^{i\phi_{NL}}$$

$$\phi_{NL} = -\gamma |a_1|^2 (1 - b^2) / (2 \ln b)$$

... nelineární změna fáze (automodulace)

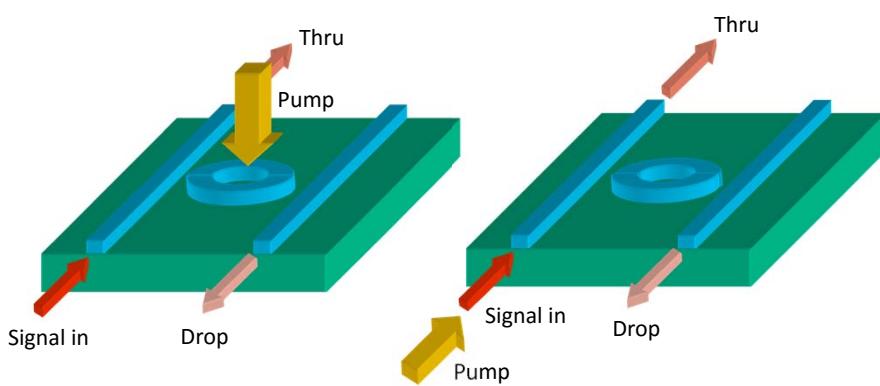


Úloha

Jednoduchý model optického spínání v mikrorezonátoru

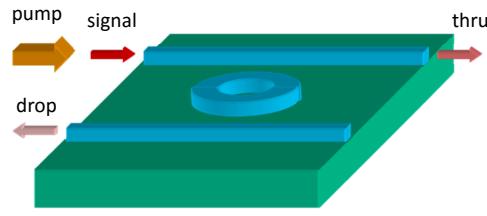
Vertikální čerpání:
jednoduché, rychlé,
vhodné pro základní experiment

Vlnovodné čerpání:
rezonanční zesílení; pomalejší,
ale vhodné pro aplikace



Úloha

Spínač využívající křížovou fázovou modulaci v mikrezonátoru



Parametry:

Materiál: Křemík na SiO_2
 Průměr mikrezonátoru: 10 μm
 Rozměry vlnovodů: 300×400 nm
 Nosná vln.délka signálu: 1545 nm
 Vlnová délka čerpacího impulsu: 1577 nm
 Vstupní impuls: gaussovský, $t_s \approx 5$ ps
 Čerpací impuls: gaussovský, $t_p \approx 5$ ps
 Špičkový čerpací výkon: $P_p \approx 2.5$ W

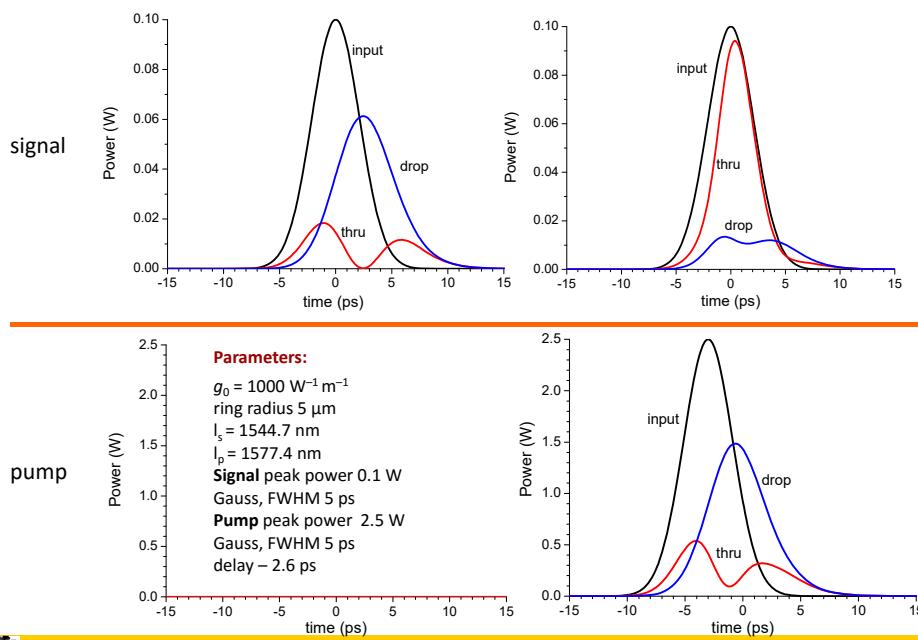
Interakce je popsána dvojicí vázaných nelineárních rovnic pro dva (spektrálně se nepřekrývající) impulsy:

$$\frac{\partial u_s(z,t)}{\partial z} - i\beta_{0,s}u_s + \beta_{1,s}\frac{\partial u_s}{\partial t} + i\frac{\beta_{2,s}}{2}\frac{\partial^2 u_s}{\partial t^2} - \frac{\beta_{3,s}}{6}\frac{\partial^3 u_s}{\partial t^3} + \dots = i\gamma_{0,s}u_s(|u_s|^2 + 2|u_p|^2) \quad \dots \text{signál}$$

$$\frac{\partial u_p(z,t)}{\partial z} - i\beta_{0,p}u_p + \beta_{1,p}\frac{\partial u_p}{\partial t} + i\frac{\beta_{2,p}}{2}\frac{\partial^2 u_p}{\partial t^2} - \frac{\beta_{3,p}}{6}\frac{\partial^3 u_p}{\partial t^3} + \dots = i\gamma_{0,p}u_p(2|u_s|^2 + |u_p|^2) \quad \dots \text{čerpání}$$

Úloha

Nelineární optické přepínání: časová závislost



Výhody a nevýhody vlnovodných struktur s mikrorezonátory

Výhody:

- Relativně velká variabilita realizovatelných funkcí
– spektrální filtr, modulátor, přepínač, laser(?), ...
- Technologická homogenita prvků s různými funkcemi
- Malé rozměry stavebních bloků (řádu 10 µm)

Nevýhody:

- Vysoká technologická náročnost
- Návrh a modelování vyžaduje nové metody
(3D, vše směrové šíření)
- Obtížnost účinné vazby na vláknové vlnovody
- Omezené technické parametry
(šířka pásma filtru, mezní frekvence modulátoru, ...)

Dnes patrně nejperspektivnější technologie pro „large-scale photonic integration“

Měření parametrů

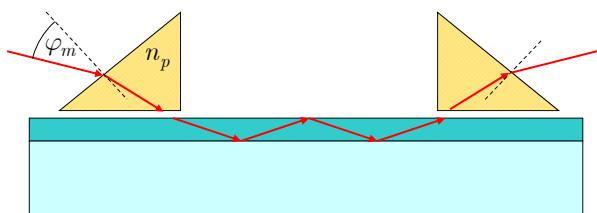
fotonických vlnovodných struktur

Metody měření základních parametrů vlnovodů

1. Vidová spektroskopie planárních vlnovodů
 - metody určování profilu indexu lomu
 - dvouhranolová, jednohranolová metoda
 - měření s pomocí vazební mřížky
2. Měření útlumu vlnovodů
 - útlum planárních vlnovodů
 - útlum kanálkových vlnovodů – rezonátorová metoda
 - měření grupového indexu lomu
3. Měření spektrálních vlastností vlnovodních struktur
 - měření spektrálních charakteristik
4. Měření dynamických vlastností vlnovodních struktur
 - měření parametrů EO modulátorů
 - měření vlastností AO vlnovodů

Úloha

Vidová spektroskopie planárních vlnovodů



$$N = n_p \cos \chi$$

$$n_p \sin \sigma = \sin \varphi$$

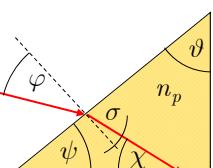
$$\chi + \sigma + (\pi - \vartheta) = \pi, \quad \chi = \vartheta - \sigma$$

$$N = n_p \cos \chi = n_p \cos \vartheta \cos \sigma + n_p \sin \vartheta \sin \sigma$$

$$n_p \cos \sigma = \sqrt{n_p^2 - n_p^2 \sin^2 \sigma} = \sqrt{n_p^2 - \sin^2 \varphi}$$

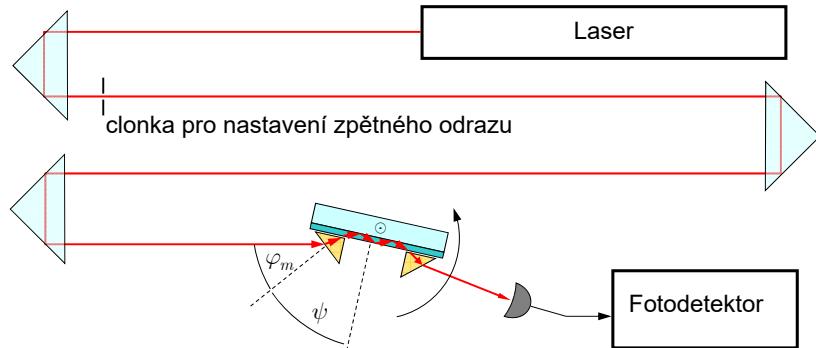
$$N = \sqrt{n_p^2 - \sin^2 \varphi} \cos \vartheta + \sin \vartheta \sin \varphi$$

$$N_m = \sqrt{n_p^2 - \sin^2 \varphi_m} \sin \psi + \cos \psi \sin \varphi_m$$



Úloha

Experimentální uspořádání: metoda dvou hranolů



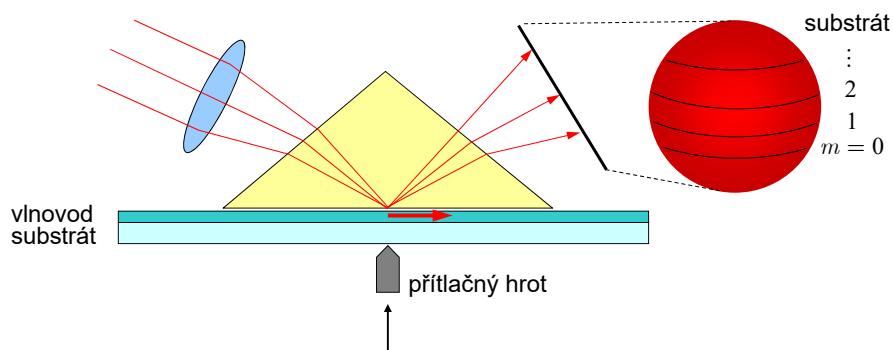
Vlnovod je umístěn na otočném stolku (goniometru)

1. Nastavíme kolmý odraz od vlnovodu
 2. Nastavíme kolmý odraz od hranolu
 3. Nastavujeme synchronní úhly φ_m
 4. Vypočteme N_m
- $$N_m = \sqrt{n_p^2 - \sin^2 \varphi_m} \sin \psi + \cos \psi \sin \varphi_m$$

Často lze současně měřit i index lomu podložky

Úloha

Jednohranolová metoda („tmavá“ vidová spektroskopie)



Pokud synchronní úhly všech vidů leží uvnitř vstupního kuželevybudí se všechny vidy současně. Na stínítku vznikne světlý kruh s tmavými čarami v místech odpovídajících výstupním úhlům vidů, poněvadž vybuzené vidy odvedou energii z místa dopadu optického svazku.

Stínítko lze okalibrovat přímo v hodnotách ef. indexů lomu, nebo je možno smírat rozložení pole CCD kamerou a ze zpracování obrazu vyhodnotit hodnoty ef. indexů lomu

Úloha

Určení profilu indexu lomu planárního vlnovodu ze spektra vedených vidů

$$k_0 \mathbf{d} \sqrt{n_g^2 - N_m^2} = \arctan \left[\left(\frac{n_g}{n_s} \right)^{2\nu} \sqrt{\frac{N_m^2 - n_s^2}{n_g^2 - N_m^2}} \right] + \arctan \left[\left(\frac{n_g}{n_s} \right)^{2\nu} \sqrt{\frac{N_m^2 - n_s^2}{n_g^2 - N_m^2}} \right] + m\pi$$

U vrstvového vlnovodu stačí v principu znát hodnotu ef. indexu 2 vidů, poněvadž neznáme 2 parametry – tloušťku a index lomu vlnovodné vrstvy.

Pokud je vidů více, hledáme minimum výrazu

$$\sigma_d = \frac{1}{M-1} \sqrt{\sum_{m=0}^{M-1} (d_m - \bar{d})^2}, \quad \bar{d} = \frac{1}{M-1} \sum_{m=0}^{M-1} d_m$$

$$d_m = \frac{1}{k_0 \sqrt{n_g^2 - N_m^2}} \left\{ \arctan \left[\left(\frac{n_g}{n_s} \right)^{2\nu} \sqrt{\frac{N_m^2 - n_s^2}{n_g^2 - N_m^2}} \right] + \arctan \left[\left(\frac{n_g}{n_s} \right)^{2\nu} \sqrt{\frac{N_m^2 - n_s^2}{n_g^2 - N_m^2}} \right] + m\pi \right\}$$

jako funkci indexu lomu vrstvy n_g .

Nejpravděpodobnější hodnota tloušťky je pak \bar{d} .

Úloha

Určení profilu indexu lomu difúzního vlnovodu ze spektra vedených vidů

WKB approximace: $k_0 \int_0^{x_0} \sqrt{n^2(x) - N_m^2} = \arctan \left[\left(\frac{n(0)}{n_a} \right)^{2\nu} \sqrt{\frac{N_m^2 - n_a^2}{n^2(0) - N_m^2}} \right] + \left(m + \frac{1}{4} \right) \pi$

$\approx \frac{\pi}{2}$, pokud $n^2(0) - N_m^2 \ll N_m^2 - n_a^2$

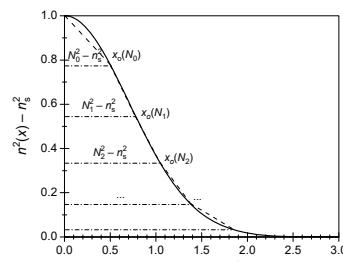
$$f(N_m) = k_0 \int_0^{x_0(N_m)} \sqrt{n^2(x) - N_m^2} dx \cong \left(m + \frac{3}{4} \right) \pi.$$

Předpokládejme profil indexu lomu ve tvaru po částech lineární funkce s vrcholy v bodech (x_m, N_m) .

Integrál je pak možno spočítat analyticky; získáme rekurentní vzorec

$$x_m = x_{m-1} + (N_{m-1}^2 - N_m^2)^{-1/2} \times \quad (\text{White a Heidrich. 1976})$$

$$\times \left\{ \frac{3}{4} \lambda \left(m - \frac{1}{4} \right) - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{x_k - x_{k-1}}{N_{k-1}^2 - N_k^2} \left[(N_{k-1}^2 - N_m^2)^{3/2} - (N_k^2 - N_m^2)^{3/2} \right] \right\}$$



pro určení „bodů obratu“ (hloubek vlnovodu, ve kterých je hodnota indexu lomu vlnovodu rovna efektivnímu inklexu lomu daného vidu).

Kritické je určení hodnoty $n(0)$ na povrchu vlnovodu.

Úloha

Určení profilu indexu lomu gradientního vlnovodu: dvouparametrický profil

Parametry obecného dvouparametrického profilu (gaussovského, parabolického, lineárního ap. lze určovat podobně: nechť

$$n^2(x) = \begin{cases} n_s^2 + [n^2(0) - n_s^2]f(x/x_d), & \xi \geq 0, \\ n_a^2, & \xi < 0 \end{cases}$$

$f(\xi)$ je monotónně klesající funkce, $0 < f(\xi) < 1$.

Neznáme povrchovou hodnotu indexu lomu $n(0)$ a difúzní hloubku x_d .
Pak můžeme použít postup jako u vrstvy:

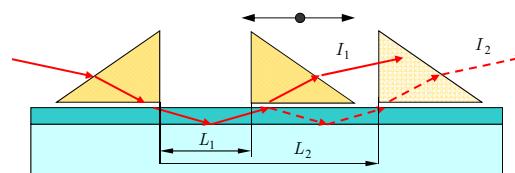
$$k_0 x_{d,m} = \frac{\left(m + \frac{3}{4}\right)\pi}{\int_0^{x_0(N_m)/x_d} \sqrt{n^2(x/x_d) - N_m^2} d(x/x_d)} \quad \bar{x}_d = \frac{1}{M-1} \sum_{m=0}^{M-1} x_{d,m}$$

$$\sigma_d = \frac{1}{M-1} \sqrt{\sum_{m=0}^{M-1} (d_m - \bar{d})^2}.$$

Úloha

Měření útlumu planárních vlnovodů

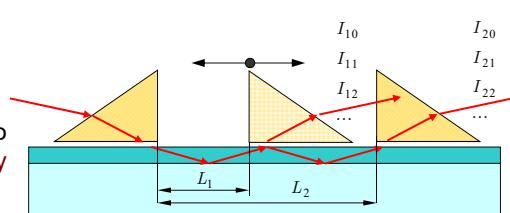
Dvouhranolová metoda:



$$b = \frac{10 \log(I_{out,1}/I_{out,2})}{(L_2 - L_1)} \quad [\text{dB/cm}] \quad \text{Problém: neměnit účinnost (výstupní) vazby}$$

Tříhranolová metoda:

Měníme polohu středního hranolu bez změny vazby vstupního a výstupního hranolu (!!!)



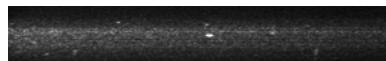
Problém: vzorek musí mít dostatečně velké rozměry

Přesnost metody typicky řádu 1 dB/cm

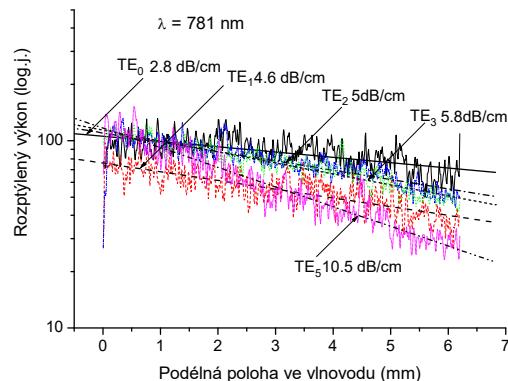
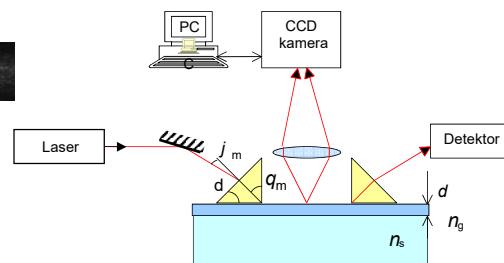
Úloha

Měření útlumu planárních vlnovodů

Metoda snímání rozptýleného záření



Příklad sejmuty stopy
v GaN vlnovodu na safíru



Útlum roste s vidovým indexem, což je typická vlastnost vlnovodů, u nichž je dominantním mechanismem ztrát rozptylu na rozhraních mezi vlnovodnou vrstvou a okolními prostředími

Měření s fázovým kontrastem a heterodynou detekcí

Heterodyne detection:

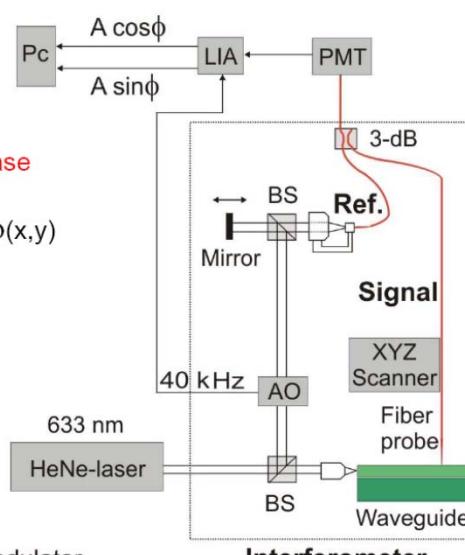
Both **amplitude** and the **phase** of light are retrieved
($A(x,y)\cos\phi(x,y)$ & $A(x,y)\sin\phi(x,y)$ measured)

ϕ = Phase

A = Amplitude

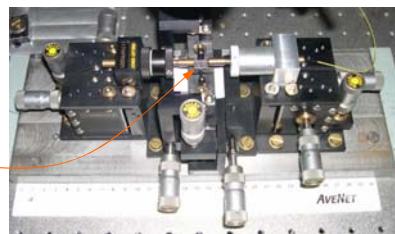
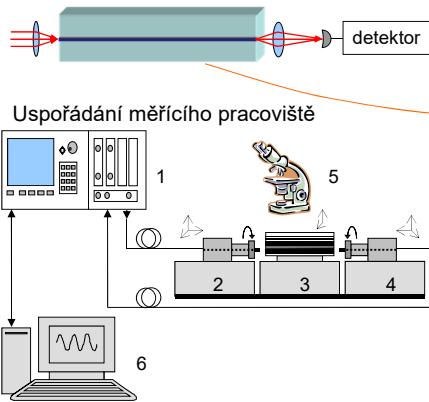
LIA = Lock-In Amplifier

AO = Acousto-Optic Modulator



Měření útlumu kanálkových vlnovodů

Metoda Fabryových-Perotových rezonancí



Kanálkový vlnovod se chová jako FP rezonátor v důsledku odrazů od leštěných čel vlnovodu

Modální transmitance

$$T = \left| \frac{(1-R^2)\exp(-\alpha L)}{1+R^2\exp(-\alpha L)\exp(2ik_0NL)} \right|^2,$$

R je modální reflektance, α činitel útlumu, L délka

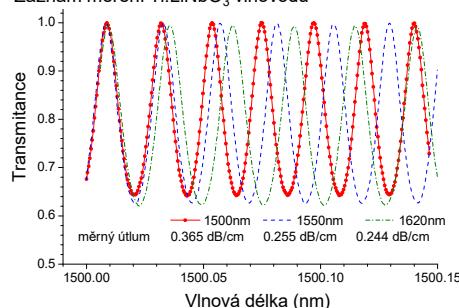
Z poměru max. a min. transmitance vyjádříme měrný útlum (dB/cm)

$$b = \frac{4.34}{L} \left(\ln \frac{1+\sqrt{K}}{1-\sqrt{K}} - 2 \ln \frac{N+1}{N-1} \right), \quad K = \frac{T_{\max}}{T_{\min}}.$$

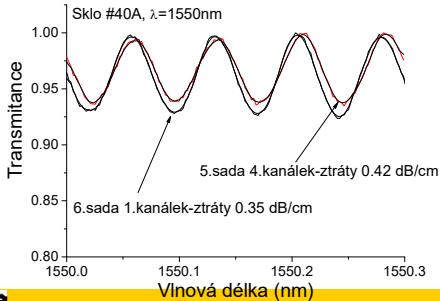
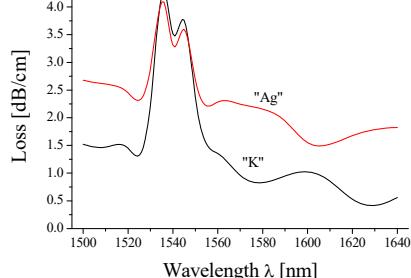
Útlum

Měření útlumu kanálkových vlnovodů

Záznam měření Ti:LiNbO₃ vlnovodu



Spektrální závislost útlumu vlnovodů vytvořených iontovými výměnami Ag⁺↔Na⁺ a K⁺↔Na⁺ ve skle dopovaném Er³⁺



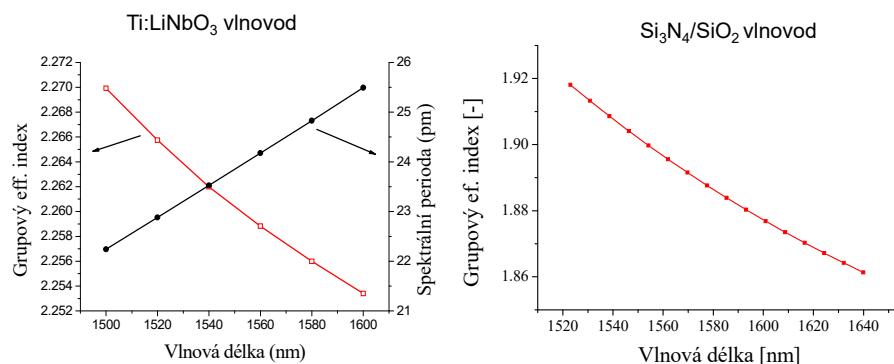
Útlum

Měření grupového indexu lomu kanálkových vlnovodů

Rezonanční podmínka FP rezonátoru je dána vztahem $\frac{2\pi\nu_q}{c} N(\nu_q)L = \pi q$, q je celé číslo

Pro vzdálenost sousedních rezonancí (FSR) platí $\Delta[\nu N(\nu)] = \left(N + \nu \frac{dN}{d\nu} \right) d\nu = N_g \Delta\nu = \frac{c}{2L}$,

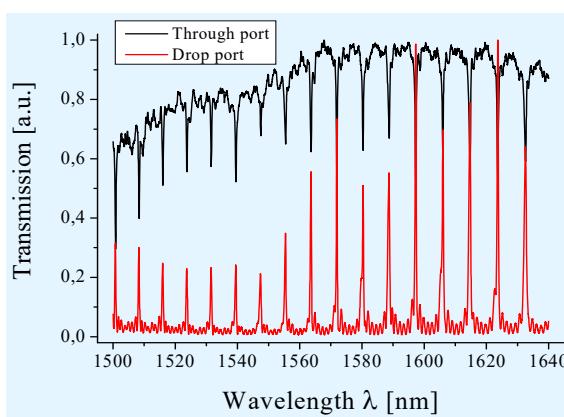
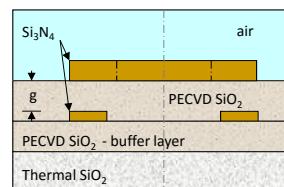
$$\Delta\nu = \frac{c}{2N_g L}, \text{ nebo } N_g = \frac{c}{2\Delta\nu L} = \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda L} \dots \text{ grupový index lomu}$$



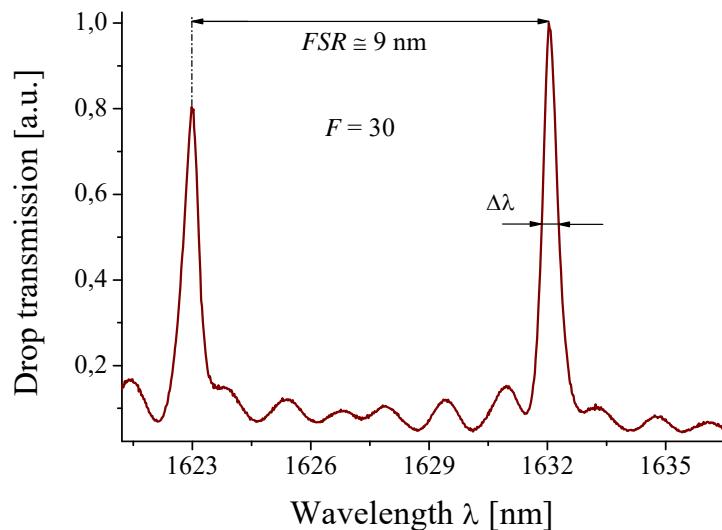
Charakterizace mikrorezonátorů

(F. Ondráček, FEL ČVUT a ÚFE)

$\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2$ prstencový μR , $R = 50 \mu\text{m}$
technologie: Uni Twente, NL

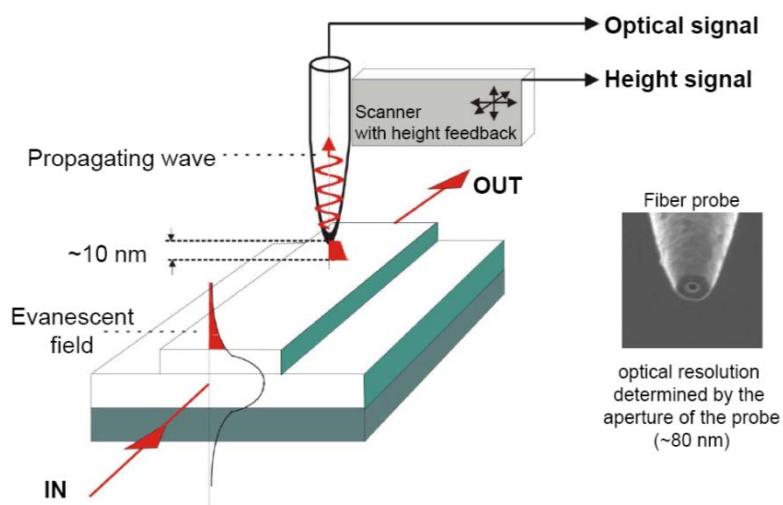


$\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2 \mu\text{R}$
(vzorek Uni Twente)



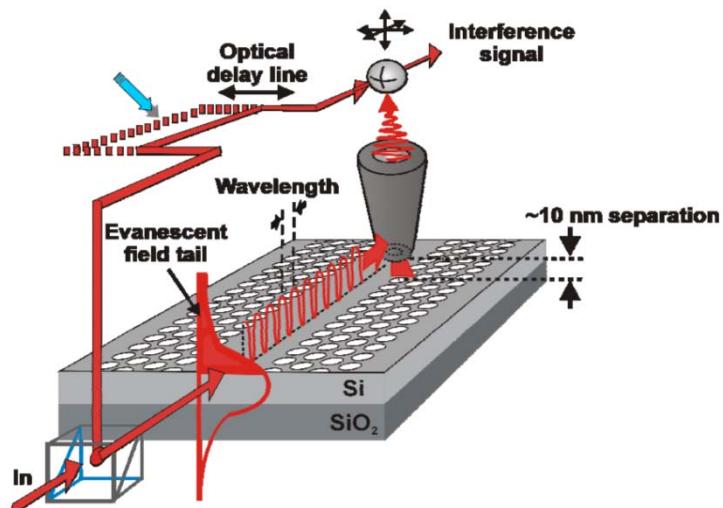
Úloha

Měření blízkého pole skanovacím optickým mikroskopem



Úloha

Interferometrické měření s fázovým kontrastem



Šíření femtosekundového impulsu v mikrorezonátoru

Experiment:
interferenční mikroskopie
blízkého pole,
Uni Twente, NL, 2003

Délka impulsu ~ 80 fs,
vlnová délka ~ 800 nm
(Ti:safírový laser)

